

Einladung zum 251. PTB-Seminar

Neue Trends in der optischen Ebenheitsmesstechnik

Ort: Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig
Seminarraum 133, Vieweg-Bau
Zeit: Dienstag, 20. Oktober 2009
Beginn: 10:00 Uhr, Ende: ca. 17:00 Uhr

In den letzten Jahren wurden große Fortschritte auf dem Gebiet optischer Ebenheitsmessverfahren erzielt. Insbesondere bei der Interferometrie, Deflektometrie und auch bei anderen Messprinzipien sind interessante Entwicklungen hinsichtlich Auflösung, Genauigkeit, Vielseitigkeit und Auswerteverfahren zu beobachten.

Die PTB lädt vor diesem Hintergrund zu einem eintägigen Seminar ein, in dem die aktuellen Trends und neue Entwicklungen auf diesem Gebiet vorgestellt und diskutiert werden. Ziel des Seminars ist es, das Potenzial der einzelnen Messverfahren darzulegen, Anregungen für Verwendung der vorgestellten Messverfahren zu geben und in Diskussionen zu vertiefen.

Leitung: *Dr. M. Schulz* Arbeitsgruppe 4.21 ☎ 0531 - 592 4210
Dr. C. Elster Arbeitsgruppe 8.42 ☎ 030 - 3481 7492

Fax: 030 - 3481 7030
E-Mail: Ebenheitsseminar@ptb.de
Förderung: Das Seminar wird durch den Helmholtz-Fonds e.V. finanziell unterstützt

Seminargebühr: 130 € (freie Teilnahme für Mitglieder des Helmholtz-Fonds e.V.)

Kennwort: **251. PTB-Seminar**

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie diese Einladung an interessierte Kollegen weitergeben könnten.

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis zum 9. Oktober 2009 per E-Mail oder Fax an die o.a. Adressen.

Programm

- 10:00 Begrüßung
- 10:15 Möglichkeiten und Grenzen der Deflektometrie
G. Häusler, Institut für Optik, Information und Photonik, Universität Erlangen-Nürnberg
- 10:45 Winkelmessende Deflektometrie für die Charakterisierung ultrapräziser Synchrotron Optiken
F. Siewert, T. Zeschke, J. Buchheim, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH
- 11:15 Konzipierung des neuen deflektometrischen Referenzsystems der PTB mit Hilfe virtueller Experimente
G. Ehret, M. Stavridis, M. Schulz, C. Elster
- 11:45 Multipass-Interferometrie und Multipass-Shack-Hartmann-Test für die Messung der Ebenheit
J. Schwider, Institut für Optik, Information und Photonik, Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
- 12:15 Gemeinsames Mittagessen
- 13:15 Ebenheitsmetrologie aus US-amerikanischer Perspektive
U. Griesmann, NIST, USA
- 13:45 Die Spiegelhalter des Hochenergie-Petawatt Lasers PHELIX
S. Borneis, GSI, Darmstadt
- 14:15 Interferometrische Ebenheitsmessung von feinbearbeiteten Oberflächen
B. Packroß, Lamtech Lasermesstechnik GmbH, Stuttgart
- 14:45 Kaffepause
- 15:15 Optische Ebenheitsmessung mit Punktsensoren
T. Fries, FRT GmbH, Bergisch Gladbach
- 15:45 Multiple Sensorsysteme zur Topographiebestimmung optischer Oberflächen
A. Wiegmann, M. Schulz, C. Elster
- 16:15 Abschlussdiskussion
- 17:00 Ende